



ساخت میکروآئینه انعطاف پذیر پلیمری با تحریک الکتروستاتیک

مهرناز اسفندیاری^۱، رضا اسدی^۲، پیام حیدری^۳ و علیرضا شمس^۴

^{۱،۲} تهران، لویزان، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

^{۳،۴} تهران، رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

چکیده - در این مقاله روشی نوین جهت ساخت میکروآئینه انعطاف پذیر پلیمری مبتنی بر عملگر الکترواستاتیک ارائه شده است. استفاده از عملگر الکترواستاتیک در ساخت میکروآئینه ها دلیل دقت بالا و سادگی در ساخت، گزینه مطلوبی می باشد. اما نیاز به ولتاژ تحریک بالا استفاده از این نوع عملگر را محدود می کند. برای رفع این مشکل، یکی از راهکارها استفاده از مواد پلیمری با مدول الاستیک بسیار پایین بجای سیلیکون است. اما آئینه ساخته شده با استفاده از پلیمر، صافی سطح کمتری در مقایسه با سیلیکون دارد. در این مقاله برای غلبه بر این مشکل از راهکاری برای ساخت میکروآئینه استفاده شده که علاوه بر تمام مزایای آئینه پلیمری از نظر صافی سطح با نمونه های سیلیکونی برابری می کند.

کلید واژه - اپتیک تطبیقی، پلیمر SU-8، عملگر الکتروستاتیکی، میکرو آئینه.

Fabrication of deformable polymer micro mirror with electrostatic actuation

Mehrnaz Esfandiari¹, Reza Asadi², Payam Heydari³, Alireza Shamsi⁴

^{1,2} Maleke Ashtar university of Technology, Lavizan, Tehran.

^{3,4} Islamik Azad university, Rodehen branch, Rodehen, Tehran

Abstract- In this paper, a novel method for fabrication of a polymeric deformable micro-mirror with electrostatic actuator is presented. Electrostatic actuators are a desirable choice for micro-mirrors due to their accurate deformation control and simple fabrication process. Despite these promising the development of the electrostatic actuator is limited because of for high actuation voltage. To solve this problem, we utilize metalized thin SU-8 diaphragm as deformable mirror. but the Surface roughness of polymeric mirror is lower than silicon ones. in this paper we propose the fabrication method to overcome this problem. Furthermore the proposed method has using a fast and low-cost fabrication method by the high quality of surface mirror.

Keywords: Adaptive optics, electrostatic actuator, micromirror, SU-8.

۱- مقدمه

آئینه‌های انعطاف پذیر یکی از موثرترین ادوات در تکامل سیستم‌های اپتیکی از قبیل سوچ های نوری، پرژکتورهای دیجیتال نوری^۱ (DLP)، نمایشگرهای لیزر HD^۲ و سیستم های اپتیک تطبیقی می باشند. با استفاده از این آئینه ها، امکان رفع اثرات نامطلوب ناشی از آبراه های مختلف در سیستمهای تصویر بردار و افزایش دقت هندسی سیستمهای اپتیکی فراهم می شود. [۱ و ۲]

آئینه های انعطاف پذیر معمولاً بر مبنای عملگر های پیزو الکتریک و در ابعاد بزرگ ساخته می‌شوند که مشکلاتی از قبیل هزینه بالا و وزن زیاد را به همراه داشت اما در دهه های اخیر با بهره گیری از تکنولوژی MEMS^۳ و روش های میکروماشینکاری حجمی و سطحی، آئینه های انعطاف پذیر در ابعاد میکرو با توان مصرفی پایین، دقت و سرعت عملکرد بالا ساخته می‌شوند [۳].

مشخصات آئینه های انعطاف پذیر متناسب با کاربرد آنها متفاوت است اما بازرترین آنها عبارتند از : میزان جابجایی، سرعت پاسخ دهی و صافی سطح [۴] که ارتباط مستقیم با نوع عملگری دارد که برای تحریک آئینه به کار می‌رود. میکروعملگرهای الکترواستاتیکی، با توجه به مزایایی همچون حساسیت مناسب، پاسخ دهی سریع، دقت بالا، قابلیت مجتمع سازی با تکنولوژی CMOS و ساخت ساده تر نسبت به سایر عملگرها، همواره مورد توجه طراحان و سازندگان ادوات MEMS به‌ویژه در میکروآئینه ها بوده است. اما نیروهای الکترواستاتیکی در ابعاد میکرومتر نسبتاً کوچک بوده و برای ایجاد جابجایی قابل توجه، ولتاژ تحریک بالایی مورد نیاز است. حال آنکه استفاده از سیلیکون به عنوان پرکاربردترین ماده برای ساخت این قطعات، بر این مشکل می‌افزاید [۵ و ۶]. چراکه سیلیکون با داشتن مدول یانگ در حدود ۱۶۰ GPa نه تنها مقاومت مکانیکی بالایی در مقابل تغییر وضعیت مکانیکی از خود نشان می‌دهد، بلکه برای ایجاد جابجایی به نیروی الکترواستاتیکی زیادی نیاز دارد و این امر سبب افزایش ولتاژ تحریک مورد نیاز در عملگر الکترواستاتیکی می‌شود. [۷] برای رفع این مشکل، یکی از روشهای

پیشنهادی استفاده از مواد پلیمری مانند SU-8 است که مدول یانگ آنها نسبت به سیلیکون کمتر است [۷]، اما با توجه به اینکه در این روش برای لایه نشانی SU-8 باید از لایه نشانی با صفحه چرخان^۴ استفاده کرد، دستیابی به سطوح صاف و بدون اعوجاج یکی از چالشهای اصلی می‌باشد.

برای رفع این چالشها، در این مقاله روش جدیدی برای ساخت آئینه های انعطاف پذیر پلیمری ارائه می شود که در آن از دیافراگم پیوسته SU-8 با پوشش فلزی و قاب سیلیکونی بر روی مجموعه ای از عملگرهای الکترواستاتیک استفاده شده است. مزیت این روش صافی سطح مناسب به همراه سادگی نسبی فرآیند ساخت به علت استفاده از روش سونش شیمیایی می باشد. ضمن اینکه به علت استفاده از دیافراگم پلیمری با مدول یانگی ۵۰ برابر کمتر از سیلیکون [۷]، مقدار جابجایی قابل توجهی با ولتاژ تحریک نسبتاً پایین بدست می آید.

در این روش، ضمن دستیابی به صافی مطلوب، با استفاده از سونش شیمیایی به جای سونش های متداول فیزیکی، نیاز به استفاده از تجهیزات گران قیمت و پیچیده مانند سونش خشک DRIE مرتفع گردیده و زمان ساخت در قیاس با سایر روش ها کاهش چشمگیری داشته است که آن را به گزینه مناسبی برای تولید انبوه به‌ویژه در ادواتی که دارای دیافراگم هستند مبدل می‌سازد.

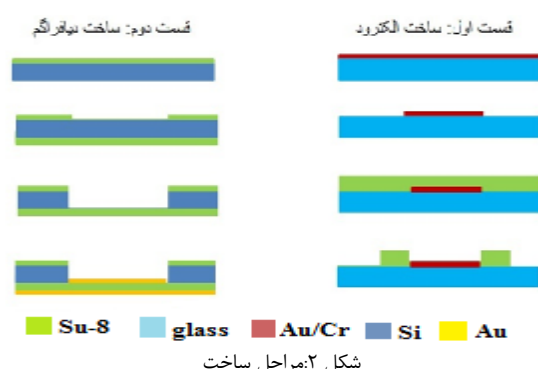
علاوه براین، با توجه به اینکه دیافراگم بر روی آرایه ای از عملگرها قرار می‌گیرد می توان آن را با دقت بیشتری و به صورت کنترل شده جابجا کرد.

۲- ساختار میکروآئینه

همانگونه که در شکل ۱ نشان داده شده است، میکروآئینه ساخته شده از دو بخش مجزا تشکیل شده است. قسمت اول، مجموعه ای از الکترودهای ثابت که بر روی زیرلایه شیشه ای قرار دارد و قسمت دوم، الکترودهای متحرک که به صورت دیافراگمی پلیمری از جنس SU-8 به ضخامت ۱۰ میکرومتر بوده و روی آن با لایه ای از فلز پوشانده شده و بر روی یک قاب نگه دارنده سیلیکونی قرار گرفته است. نیروی جاذبه الکترواستاتیکی بین دو الکترودها با بار مخالف، سبب جابجایی الکترودهای متحرک می شود. فاصله بین

^۱ digital light projector^۲ high-definition (HD) laser display,^۳ Microelectromechanical^۴ Spin coating

سپس با استفاده از دستگاه لایه نشانی حرارتی، پشت دیافراگم، با فلز طلا به ضخامت ۱۵۰ نانومتر پوشانده شده تا رسانا گشته و به عنوان الکتروود متحرک مورد استفاده قرار گیرد. سپس قسمت روی دیافراگم را نیز با همان روش، با فلز طلا می‌پوشانیم تا سطح شفاف آینه شکل گیرد. (شکل ۳-ب)



شکل ۲: مراحل ساخت

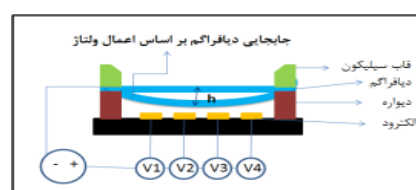
مزیت عمده این روش این است که برای سونش سیلیکون نیازی به استفاده از دستگاه DIRE یا سایر روش‌های پر هزینه و زمان‌بر نیست. علاوه بر این، سونش سیلیکون با چنین عمقی (حدود ۴۵۰ میکرومتر) با بسیاری از روش‌ها امکان‌پذیر نمی‌باشد. برای ساخت الکتروود و دیواره‌ها، ابتدا فلزات کروم و طلا به ترتیب با ضخامت‌های ۳۰ و ۱۲۰ نانومتر روی زیرلایه‌ای شیشه‌ای لایه نشانی شده و به شکل مجموعه‌ای از الکتروودهای شش ضلعی سونش شده اند. سپس با استفاده از SU-8 2025 الگویی به شکل دیواره در پیرامون الکتروود فلزی با ضخامت ۲۵ میکرومتر ایجاد گردیده است. (شکل ۳-الف)

در انتها دیافراگم ساخته شده و الکتروودهای احاطه شده با دیواره‌ها را با استفاده از SU-8 2002 به عنوان ماده چسبنده^۶ به یکدیگر چسبانده ایم.



شکل ۳: (الف) تصویری از الکتروودهای شش ضلعی به همراه دیواره (ب) دیافراگم پلیمری

الکتروودها و دیافراگم نیز بوسیله دیواره‌هایی از جنس SU-8 ایجاد گردیده است. مزیت مهم دیگر پلیمر SU-8، قابلیت آن در لایه نشانی با ضخامت‌های متنوع از ۵۰۰ نانومتر تا چندین میلیمتر است. با استفاده از این ویژگی می‌توان ضخامت دیافراگم و فاصله بین دیافراگم و الکتروودهای ثابت را با مقادیر دلخواهی پیاده سازی نمود. همانگونه که در فرآیند ساخت اشاره خواهد شد، در انتها این دو قسمت به یکدیگر چسبانده^۵ می‌شوند.



شکل ۱: شماتیکی از میکروآینه مورد بررسی

۳- فرآیند ساخت

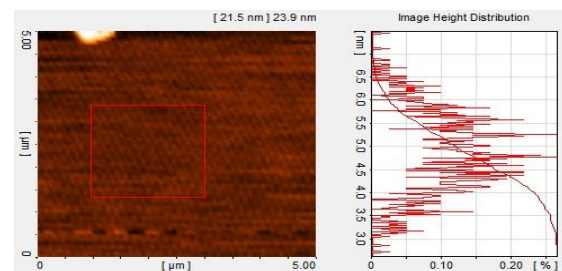
شکل ۲ خلاصه‌ای از فرآیند ساخت این میکروآینه را نشان می‌دهد. جهت ساخت دیافراگم، ابتدا SU-8 از نوع 2010 به روش لایه نشانی با صفحه چرخان با سرعت ۳۰۰۰ دور بر دقیقه به ضخامت ۱۰ میکرومتر روی یک بستر سیلیکونی لایه نشانی شده است. از سیلیکون به عنوان قاب نگه دارنده دیافراگم استفاده شده است. سپس ناحیه میانی سیلیکون را به شکل الگویی مربع شکل به طور کامل با روش سونش شیمیایی با کاتالیز فلزی سونش نموده ایم [۸] تا به SU-8 برسیم. با توجه به اینکه لایه نشانی مواد پلیمری با استفاده از صفحه چرخان انجام می‌شود به سختی می‌توان سطح کاملاً یکنواخت و بدون اعوجاج ایجاد کرد لذا لایه نشانی پلیمر بر روی سیلیکون سبب می‌شود سطحی از پلیمر لایه نشانی شده که روی سیلیکون قرار می‌گیرد، کاملاً یکنواخت شود سپس با سونش سیلیکون به دیافراگم پلیمری کاملاً یکنواخت و بدون اعوجاج میرسیم. از طرف دیگر، نوع و جهت کریستالی ویفر سیلیکون مورد استفاده اهمیتی در این روش سونش بکار رفته در این مقاله نداشته و روی هر نوع ویفری قابل پیاده‌سازی است و این موضوع یکی دیگر از مزایای این روش سونش می‌باشد.

⁶ Adhesion Layer

⁵ Bonding

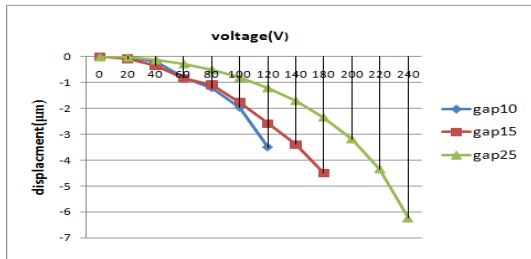
۴- بحث و نتایج

همانگونه که در قسمت مقدمه اشاره شد، سه پارامتر اصلی مشخص کننده کیفیت میکروآینه عبارتند از: صافی سطح، میزان جابجایی و سرعت پاسخدهی. برای بررسی این موارد در آینه ساخته شده، پس از ساخت قطعه، ناهمواری‌های سطح آن با استفاده از میکروسکوپ اتمی AFM اندازه‌گیری شد که حدود ۲۰ نانومتر بدست آمد (شکل ۴) که در مقایسه با موارد مشابه، صافی سطح آن، دو برابر افزایش داشته است [۳]. همچنین وضوح تصویر ایجاد شده ناشی از بازتابش نور از سطح آینه، مربوط به تختی و صاف بودن سطح آینه می‌باشد. خطای تخت بودن، نسبت به یک سطح تخت ایده آل اندازه گرفته می‌شود که باید کمتر از $\lambda/10$ باشد که در نمونه ساخته شده برای نور مرئی کاملاً محرز گردیده است.



شکل ۴: ناهمواری سطح اندازه‌گیری شده توسط میکروسکوپ نیروی اتمی

برای آزمودن صحت عملکرد میکرو آینه، ولتاژهایی در محدوده ۰ تا ۲۰۰ ولت به یکایک الکترودها اعمال شده و جابجایی دیافراگم با استفاده از یک سیستم اپتیکی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. سیستم اپتیکی مورد استفاده از نوع خودکانون بوده و نمودار جابجایی‌های اندازه‌گیری شده توسط این سیستم برای نمونه‌های ساخته شده با فاصله صفحات ۱۰ تا ۲۵ میکرومتر به ازای ولتاژهای مختلف در شکل ۵ به نمایش در آمده است. همانگونه که در نمودار مشخص است، برای ولتاژ ۱۲۰ ولت جابجایی در نمونه‌های مختلف از ۱/۲ تا ۳/۵ میکرومتر می‌باشد که در مقایسه با نمونه‌های سیلیکونی ساخته شده مانند [۹] بیش از ۳ مرتبه افزایش یافته است.



شکل ۵: نمودار میزان جابجایی به ازای اعمال ولتاژ برای دیافراگم به ضخامت ۱۰ میکرومتر

۵- نتیجه گیری

در پژوهش حاضر، تکنولوژی جدیدی برای ساخت میکروآینه انعطاف پذیر از جنس پلیمر، پیشنهاد و بر اساس آن یک نمونه میکرو آینه با قابلیت جابجایی تا ۴/۵ میکرومتر و ناهمواری سطح ۲۰ nm طراحی و ساخته شد. قطعه ساخته شده نسبت به نمونه‌های مشابه که معمولاً از جنس سیلیکون ساخته می‌شوند، قابلیت جابجایی بیشتر و ولتاژ کاری کمتری دارد. ضمن اینکه روش مورد استفاده در این تحقیق برای مواد پلیمری نسبت به روشهای دیگر بسیار ساده تر و کم هزینه تر می‌باشد. لذا می‌توان از این روش به منظور تولید انبوه میکروآینه برای کاربردهای متنوعی نظیر اپتیک تطبیقی استفاده کرد.

مراجع

- [1] J. M. EDWARDS, "MODELING AND FEEDBACK CONTROL OF A MEMS ELECTROSTATIC ACTUATOR" Cleveland State University, December, 2008.
- [2] Tyng-Yow Chen, Chen-Wei E. Chiu. "A Large-Stroke MEMS Deformable Mirror Fabricated by Low-Stress Fluoropolymer Membrane". **IEEE PHOTONICS TECHNOLOGY LETTERS**, 2008.
- [3] G Zhu, J Lévine, L Praly, Y Peter. "Flatness-Based Control of Electrostatically Actuated MEMS With Application to Adaptive Optics: A Simulation Study". **JOURNAL OF MICROELECTROMECHANICAL SYSTEMS**, 2006.
- [4] J. E. Lin, "Design and Characterization of MEMS Micromirror Devies" department of Electrical and computer engineering McGill university, montreal, Quebec, Canada, 2001.
- [5] Towghian Sh. "A Large-Stroke Electrostatic Micro-Actuator". PHD thesis, University of Waterloo, Ontario, Canada, 2010.
- [6] Nicolae Lobontiu, Ephraim Garcia. "Mechanics of Microelectromechanical Systems". Springer Science, United States of America, 2005.
- [7] Friesen Ch., Zappe H. "Deformable Polymer Adaptive Optical Mirrors". **Microelectromechanical system**, 2008.
- [8] Lianto P., Yu sh., Wu J., Thompsonad V. "Vertical etching with isolated catalysts in metal-assisted chemical etching of silicon". **The Royal Society of Chemistry**, 2012.
- [9] Miller L., Agronin M., Bartman R. "Fabrication and characterization of a micromachined deformable mirror for adaptive optics applications". **SPIE**, 1993.